

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】複数のユニット間における基板の受け渡しテストの作業効率を高める。

【解決手段】基板処理装置は、ロード／アンロードユニット2、研磨ユニット、及び洗浄ユニットを有し、これらのユニットの間で基板の受け渡しを行いながら基板に対する処理を行う。例えば、ロード／アンロードユニット2のユニット制御盤に設けられたテスト制御部（CPU）は、ロード／アンロードユニット2が洗浄ユニット及び研磨ユニットと組み立てられていない状態において、ロード／アンロードユニット2の外部に設置された基板置き台2300、2400に載置されたウェハを、搬送機構によって受け取ってロード／アンロードユニット2内に搬送したり、ロード／アンロードユニット2内に設置されたウェハを、搬送機構によって基板置き台2200まで搬送して基板置き台2200に載置したりすることによって、ロード／アンロードユニット2単体での基板の受け渡しテストを行う。

【選択図】 図8